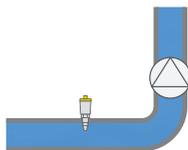




过程压力



应用范围

通过 VEGABAR 系列过程压力变送器和压力开关可以测量液体、气体和蒸汽的压力和物位。它们适用于测量化学腐蚀性强的液体以及有爆炸危险或卫生要求的介质。在产生冷凝或温度骤变的应用中，这种仪表是检测相对或绝对压力的理想选择。此外，还可以额外测量介质的温度。其准确可靠且全面的功能还可以用于静压式物位测量，比如：测量液体介质或淤泥等。所有 VEGABAR 系列 80 变送器都可以相互连接，形成电子压差系统。

测量原理

被测介质的压力作用在一个测量元件上，并被转换成为一个电信号。VEGABAR 系列中采用了一系列测量单元技术：陶瓷电容 CERTEC®、MINI-CERTEC®、金属电容 METEC®、压电和应变单元，以最好地满足各种应用要求。

优点

测量仪表可以提供一个非常大的测量范围，从真空到非常高的压力。一体式的自监控可以确保操作的安全可靠性。通过无油陶瓷电容测量元件，过程压力变送器可以提供非常高的稳定性，比如：耐过载能力、长期稳定性和温度骤变补偿都非常出色。

	VEGABAR 18	VEGABAR 19
		
应用领域	液体和气体	液体和气体，包括在高压下
测量偏差	0.5 %	0.5 %
测量元件 测量元件密封	陶瓷测量元件 FKM	金属测量元件 -
过程连接	½" 标准螺纹	½" 标准螺纹
过程温度	-40 ... +100°C	-40 ... +100°C
量程	相对压力 0 ... +25 bar (0 ... +2500 kPa)	相对压力 0 ... +100 bar (0 ... +10000 kPa)
过载强度	至 150 倍的量程	至 4 倍的量程
信号输出	两线制: 4 ... 20 mA	两线制: 4 ... 20 mA
认证	-	-
优点	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 低成本，且安装尺寸极小 ▪ 陶瓷测量元件具有最高的抗过载能力和耐真空能力，具有很高的可用性 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 低成本，且安装尺寸极小 ▪ 因使用了全焊接式金属测量元件，应用非常广泛

过程压力

	VEGABAR 28	VEGABAR 29	VEGABAR 38
			
应用领域	液体和气体	液体和气体，包括在高压下	液体和气体
测量偏差	0.3 %	0.3 %	0.3 %
测量元件	陶瓷测量元件	金属测量元件	陶瓷测量元件
测量元件密封	FKM, EPDM, FFKM	-	FKM, EPDM, FFKM
过程连接	可选齐平式的螺纹和卫生连接，通用的接口，用于各种适配系统	可选齐平式的螺纹和卫生连接，通用的接口，用于各种适配系统	可选齐平式的螺纹和卫生连接，通用的接口，用于各种适配系统
过程温度	-40 ... +130°C/ 1 h @ +135°C 蒸汽	-40 ... +130°C/ 1 h @ +135°C 蒸汽	-40 ... +130°C/ 1 h @ +135°C 蒸汽
量程	绝对压力和相对压力 -1 ... +60 bar (-100 ... +6000 kPa)	绝对压力和相对压力 -1 ... +1000 bar (-100 ... +100000 kPa)	绝对压力和相对压力 -1 ... +60 bar (-100 ... +6000 kPa)
过载强度	至 150 倍量程	至 4 倍量程	至 150 倍量程
信号输出	两线制：4 ... 20 mA 三线制：PNP/NPN, 4 ... 20 mA, IO-Link	两线制：4 ... 20 mA 三线制：PNP/NPN, 4 ... 20 mA, IO-Link	两线制：4 ... 20 mA 三线制：PNP/NPN, 4 ... 20 mA, IO-Link
显示/调整	PACTware, VEGA Tools-App, IODD	PACTware, VEGA Tools-App, IODD	内置的现场显示器和 3 键操作， PACTware, VEGA Tools-App, IODD
认证	ATEX, IEC, cULus, NEPSI, EAC, INMETRO, IA, CCOE, TIIS, KOSHA/KTL, SEPRO, EC 1935/2004, FDA, 中国 FDA, 船证	ATEX, IEC, cULus, NEPSI, EAC, INMETRO, IA, CCOE, TIIS, KOSHA/KTL, SEPRO, EC 1935/2004, FDA, 3-A, EHEDG, 中国 FDA, 船证	ATEX, IEC, cULus, NEPSI, EAC, INMETRO, IA, CCOE, TIIS, KOSHA/KTL, SEPRO, EC 1935/2004, FDA, 中国 FDA, 船证
优点	<ul style="list-style-type: none"> 因采用可配置的信号输出，简化了仓储管理 高度可视，全方位（360°）的全彩开关状态显示，可调节 用户友好型，可借助智能手机通过蓝牙进行无线调试和诊断 通过 IO-Link 通讯功能可方便地接入控制系统中 	<ul style="list-style-type: none"> 因采用可配置的信号输出，简化了仓储管理 高度可视，全方位（360°）的全彩开关状态显示，可调节 用户友好型，可借助智能手机通过蓝牙进行无线调试和诊断 通过 IO-Link 通讯功能可方便地接入控制系统中 	<ul style="list-style-type: none"> 因采用可配置的信号输出，简化了仓储管理 因采用较大的现场显示屏，并配 VDMA 操作和附加文字说明，故调试简便易行 通过 IO-Link 通讯功能可方便地接入控制系统中

VEGABAR 39	VEGABAR 81	VEGABAR 82	VEGABAR 83
			
液体和气体，包括在高压下	在高温下的液体和气体	液体和气体	即便是在高压下的液体和气体
0.3 %	0.2 %	0.2 %; 0.1 %; 0.05 %	0.2 %; 0.1 %; 0.075 %
金属测量元件 -	化学密封系统 -	CERTEC® MINI-CERTEC® FKM, EPDM, FFKM	压阻/薄膜应变片/METEC® -
可选齐平式的螺纹和卫生连接，通用的接口，用于各种适配系统	螺纹，从 G½, ½ NPT 起，法兰，从 DN 25, 1" 起，卫生接头，由 316L，合金 400，钽，黄金制成	螺纹，从 G½ 起，由 316L，Duplex，PVDF，合金制成法兰，从 DN 15, ½" 起，卫生接头	螺纹，从 G½, ½ NPT 起，法兰，从 DN 25, 1" 起，卫生接头，由 316L，合金制成
-40 ... +130°C/ 1 h @ +135°C 蒸汽	-90 ... +400°C	-40 ... +150°C	-40 ... +200°C
绝对压力和相对压力 -1 ... +1000 bar (-100 ... +100000 kPa)	绝对压力和相对压力 -1 ... +1000 bar (-100 ... +100000 kPa)	绝对压力和相对压力 -1 ... +100 bar (-100 ... +10000 kPa)	绝对压力和相对压力 -1 ... +1000 bar (-100 ... +100000 kPa)
至 4 倍的量程	与化学密封系统相关	至 200 倍的量程	至 150 倍的量程
两线制：4 ... 20 mA 三线制：PNP/NPN，4 ... 20 mA，IO-Link	4 ... 20 mA，4 ... 20 mA/HART，Profibus PA，Foundation Fieldbus，Modbus	4 ... 20 mA，4 ... 20 mA/HART，Profibus PA，Foundation Fieldbus，Modbus	4 ... 20 mA，4 ... 20 mA/HART，Profibus PA，Foundation Fieldbus，Modbus
内置的现场显示器和 3 键操作，VEGA Tools-App, IODD	PLICSCOM, PACTware, VEGADIS 81, VEGADIS 82, VEGA Tools-App	PLICSCOM, PACTware, VEGADIS 81, VEGADIS 82, VEGA Tools-App	PLICSCOM, PACTware, VEGADIS 81, VEGADIS 82, VEGA Tools-App
ATEX, IEC, cULus, NEPSI, EAC, INMETRO, IA, CCOE, TIIS, KOSHA/KTL, SEPRO, EC 1935/2004, FDA, 3-A, EHEDG, 中国 FDA, 船证	ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST), 溢流保护, 船证, SIL2/3, EC 1935/2004, FDA,	ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST), 溢流保护, 船证, SIL2/3, EC 1935/2004, FDA, 3-A	ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST), 溢流保护, 船证, SIL2/3, EC 1935/2004, FDA, 3-A, EHEDG
<ul style="list-style-type: none"> 因采用可配置的信号输出，简化了仓储管理 因采用较大的现场显示屏，并配VDMA 操作和附加文字说明，故调试简便易行 通过 IO-Link 通讯功能可方便地接入控制系统中 	<ul style="list-style-type: none"> 由于可以选择不同的接触介质的材料、充填介质和温度耦合器，故具有最佳的过程适配性 即便是在极端的介质温度下，测量也很可靠 	<ul style="list-style-type: none"> 由于采用高品质 Sapphire-Keramik® (蓝宝石陶瓷)，故抗磨损和耐腐蚀 因具有最高的过载强度和绝对的真空强度，故设备可用性高 绝对正面平齐的过程接头，确保运行免维护 	<ul style="list-style-type: none"> 由于测量元件被完全焊接，故可通用 即使在压力高的情况下测量也可靠 即使在过程温度波动厉害的情况下也能确保卓越的测量精度